(19)日本国特許庁 (JP)

# (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

# 特開平11-346050

(43)公開日 平成11年(1999)12月14日

<b>(51)</b>	Int	Cl.
(21)	ını	U.

# 識別記号

FΙ

H05K 3/34 H01L 21/60 505

H05K 3/34

505C

H01L 21/92

604R

604E

# 審査請求 未請求 請求項の数1 OL (全 5 頁)

1011			-	
(21)	m	w	ж	13

特願平10-154303

(22)出顧日

平成10年(1998) 6月3日

(71)出願人 000005821

松下電器産業株式会社

大阪府門真市大字門真1006番地

(72)発明者 永福 秀喜

大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器

産業株式会社内

(72)発明者 境 忠彦

大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器

産業株式会社内

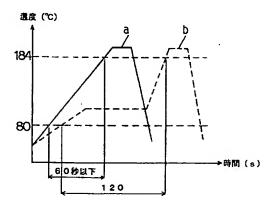
(74)代理人 弁理士 掩本 智之 (外1名)

# (54)【発明の名称】 ブリコート半田の形成方法

## (57)【要約】

【課題】 ファインビッチの電極に、半田ブリッジを形成することなく安定してブリコート半田を形成することができるブリコート半田の形成方法を提供することを目的とする。

【解決手段】 基板の電極上にソルダーペーストを塗布した後に、電極の表面にソルダーペースト中の半田を溶着させるブリコート半田の形成方法において、電極の周囲のみにパターン孔が設けられたメッシュマスクによりソルダーペーストを基板に転写し、加熱によりソルダーペースト中の半田を溶融させて前記電極に溶着させる。加熱工程において加熱温度が80°Cを超えて半田の融点温度に到達するまでの昇温時間を60秒以内とすることにより、ソルダーペーストの流動時間を短くして、軟化したソルダーペースト中での半田粒子の凝集を抑制するようにした。これにより、半田ブリッジの形成を防止することができる。



#### 【特許請求の範囲】

【請求項1】ワークの電極上にソルダーペーストを塗布 した後に前記ワークを加熱し、前記電極の表面にソルダ ーペースト中の半田を浴着させるブリコート半田の形成 方法であって、前記電極に対応する位置に限定的に開口 されたパターン孔が設けられたメッシュマスクを前記ワ ーク上に装着する工程と、このメッシュマスク上にソル ダーペーストを塗布し、スキージにより前記パターン孔 を介して前記電極の表面にソルダーペーストを印刷する 工程と、前記メッシュマスクをワークから分離して前記 10 ソルダーペーストを前記ワークに転写する工程と、加熱 によりソルダーペースト中の半田を溶融させて前記電極 に溶着させる加熱工程とを含み、この加熱工程において 加熱温度が80℃を越えてから半田の融点温度に到達す るまでの昇温時間を60秒以内とすることにより、ソル ダーペーストの流動時間を短くして、加熱により軟化し たソルダーペースト中での半田粒子の凝集を抑制すると とを特徴とするプリコート半田の形成方法。

#### 【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、ワークの電極上に 半田を溶着させてブリコート半田を形成するブリコート 半田の形成方法に関するものである。

[0002]

【従来の技術】電子部品や基板等のワークの電極を相互に半田接合する際の半田の供給方法として、ブリコート半田(半田バンブとも呼ぶ場合もある)を用いる方法が知られている。この方法は、半田接合に先立ってワークの電極表面に半田を溶着させるものであり、このブリコート半田の形成方法の1つとして、半田粒子を含有した30ソルダーベーストをワークの電極周囲に全面的に塗布するいわゆるベタ塗りを行い、その後ワークを加熱してソルダーベースト中の半田を溶融させて電極表面に溶着させる方法が広く用いられる。そして一般にソルダーベーストの塗布に際しては、従来は塗布範囲にバターン孔が形成されたステンシルマスクをワーク上面に装着し、このバターン孔内にソルダーベーストを充填させることが行われていた。

[0003]

【発明が解決しようとする課題】ところで、電子部品の 40 ファインピッチ化に伴い、ブリコート半田が形成される電極の厚さも小さくなり、したがってファインピッチのワークへのソルダーベースト塗布用として用いられるステンシルマスクの厚さは、数十ミクロンというきわめて小さいものとなっている。このためステンシルマスクは形状的に非常に不安定でたわみやすく、ワーク上に装着したときに安定せず、塗布量が部分によりばらついて安定した塗布が困難であった。

が実装されるワーク上での電極の配置もこれと対応したものとなり、矩形線上にのみ電極が配置され、この矩形の内側には電極が配置されないパターンが多い。ステンシルマスクにこのような電極の配置に対応したパターン孔を設ける際には、電極より内側の部分全体を1つのパターン孔としなければならなかった。その結果電極が存在しない部分にも大量のソルダーペーストが塗布されてしまい、ソルダーペーストが無駄に消費されることとな

たソルダーベーストはリフロー時の流動が不安定であり、その結果ブリコート半田が電極間で大きくばらつきやすいという問題点があった。このように従来のブリコート半田の形成方法は、ソルダーベーストを安定して無駄なく塗布することが困難で、その結果均一なブリコート半田の形成が困難であるという問題点があった。

っていた。また電極が存在しない位置に大量に塗布され

【0005】また、ファインピッチ電極の場合には、加熱工程においてソルダーベースト中の半田を溶融させる過程で溶融半田が電極間でつながり、半田ブリッジを形成して電極間の短格を発生するなどの不具合が生じやす20 いという問題点もあった。

【0006】そこで本発明は、ファインピッチの電極に 半田ブリッジを形成することなく安定してブリコート半 田を形成することができるブリコート半田の形成方法を 提供することを目的とする。

[0007]

【課題を解決するための手段】本発明のプリコート半田 の形成方法は、ワークの電極上にソルダーペーストを塗 布した後に前記ワークを加熱し、前記電極の表面にソル ダーベースト中の半田を溶着させるプリコート半田の形 成方法であって、前記電極に対応する位置に限定的に開 口されたパターン孔が設けられたメッシュマスクを前記 ワーク上に装着する工程と、このメッシュマスク上にソ ルダーペーストを塗布し、スキージにより前記パターン 孔を介して前記電極の表面にソルダーペーストを印刷す る工程と、前記メッシュマスクをワークから分離して前 記ソルダーペーストを前記ワークに転写する工程と、加 熱によりソルダーベースト中の半田を溶融させて前記電 極に溶着させる加熱工程とを含み、この加熱工程におい て加熱温度が80℃を越えてから半田の融点温度に到達 するまでの昇温時間を60秒以内とすることにより、ソ ルダーペーストの流動時間を短くして、加熱により軟化 したソルダーペースト中での半田粒子の凝集を抑制する

【0008】本発明によれば、メッシュマスクを使用することにより電極が存在しない位置に塗布されるソルダーペーストの量を少なくしてブリコート半田のばらつきを抑制できる。さらに、ソルダーペースト塗布後の加熱工程において、加熱温度が80℃を越えてから半田の溶設温度に到達するまでの昇温時間を60秒以内とすることにより、ソルダーペーストの溶動時間を行くして加熱

2

により軟化したソルダーペースト中での半田粒子の凝集 を抑制して、半田ブリッジの形成を防止することができ る。

### [0009]

【発明の実施の形態】次に本発明の実施の形態を図面を 参照して説明する。図1(a),(b),(c),

(d)は本発明の一実施の形態のプリコート半田の形成方法の工程説明図、図2(a)は同基板の斜視図、図2(b)は同メッシュマスクの斜視図、図2(c)は同メッシュマスクの断面図、図3は同プリコート半田の形成 10方法における加熱プロファイルのグラフ、図4(a)、(b)は同基板の部分断面図である。

【0010】まず図1(a)において、ワークである基板1の上面には複数の電極2が形成されている。電極2は基板1に実装される電子部品を半田接合するためのものであり、電子部品の実装に先立って電極2上には以下の工程に従ってブリコート半田が形成される。図1

(b) に示すように、基板1上にはメッシュマスク3が 装着され、メッシュマスク3上にはソルダーペースト4 が供給される。ソルダーペースト4には半田粒子4aが 20 含有されており、半田含有量は体積比で30%未満となるように配合されている。

【0011】 ことで、図2を参照して基板 1 およびメッシュマスク3について説明する。図3(a)は基板 1 上の電極2の配置を示しており、電極2は基板 1 の外縁部に沿って形成されており、口の字状に配列されている。口の字状配列の内側は電極が存在しない位置(領域)となっている。したがって、電極2上にブリコート半田を形成するためのソルダーペーストは電極2の周辺の口の字状に拡がる範囲Aのみに限定的に塗布すればよい。図 302(b)はこの範囲Aにのみ限定的にソルダーペーストを塗布するために用いられるメッシュマスク3を示しており、メッシュマスク3は、メッシュブレート3 a とマスクブレート3 b、3 c より構成されている。

【0012】すなわち、メッシュブレート3aの下面には矩形のマスクブレート3bおよび矩形の開口を有するマスクブレート3cが固着されており、マスクブレート3a,3bによって囲まれる開口、すなわちバターン孔3dは図2(a)に示す範囲Aに対応しており、電極2に対応する位置に限定された範囲に開口されたものとな40っている。図2(c)に示すように、マスクブレート3b,3cの厚さt1は20ミクロン程度できわめて薄く、単独では基板1の上面に安定した状態で装着することが困難である。

【0013】そこで、これらのマスクブレート3b、3cを、厚さt2が50ミクロン程度のメッシュブレート3aと組み合わせて固着することにより、全体の剛性が格段に増大し安定した状態で基板1上に装着することが可能となる。なおメッシュブレート3aのメッシュの間隔Sは40~50ミクロンであり、半田粒子4aの充填50

を妨げない充分な間隔となっている。

【0014】 CCで図1(b) に戻り、メッシュマスク3上でスキージ5を水平移動させることにより、ソルダーペースト4はメッシュブレート3 a の隙間を介してパターン孔3 d内に充填され、その後メッシュマスク3を基板1から分離することにより、図1(c)に示すようにソルダーペースト4は電極2の周囲に転写により塗布される。なお、このとき充填されたソルダーペースト4のうち、パターン孔3 d内に充填されたものだけが、メッシュブレート3の隙間内に存在するソルダーペースト4から剥離されて転写される。

【0015】この後基板1はリフロー工程に送られ、加熱される。とれによりソルダーベースト4中の半田粒子4aは溶融し、図1(d)に示すように、電極2に溶着して上面にブリコート半田4'を形成する。この後、基板1は洗浄工程に送られ、塗布されたソルダーベースト4中のフラックス成分などの残渣が除去され、ブリコート半田の形成が完了する。

【0016】とこで上記工程における加熱プロファイルについて図3を参照して説明する。図3は、ソルダーベースト4を塗布した後の加熱工程での温度変化を示したものであり、グラフaは本実施の形態における加熱プロファイルを、グラフbは従来のブリコート半田の形成方法における加熱プロファイルを示している。図3に示すように、本実施の形態では、加熱温度を従来と比較して急速に上昇させるようにしており、加熱温度が80℃を越えて半田の融点温度である184℃に到達するまでの昇温時間を60秒以内となるように加熱プロファイルが設定される。この昇温時間は、昇温途中に所定温度を保持する保持時間を設けた従来の加熱プロファイルのグラフbと比較して略半分以下の時間となっている。

【0017】 このような加熱プロファイルを採用することにより、以下に説明するように電極2間での半田ブリッジの発生を抑制する効果を得ることができる。図4 (a) は基板1上にソルダーベースト4が塗布された状態を示している。塗布されたまま加熱されない状態でのソルダーベースト4は高粘度のベースト状であるため、塗布時のばらつきによって表面はうねった状態となっており、部分的に高低差が生じやすい。

【0018】図4(b)は、加熱によりソルダーペースト4のペースト成分であるロジンが軟化してソルダーペースト4の粘度が低下した状態を示している。なお、ロジンの軟化温度は約70℃であり、この温度を超えるタイミング以降にソルダーペースト4の粘度低下が始まる。そしてソルダーペースト4の粘度が低下するとソルダーペーストの流動化が始まり、加熱前の表面に高低差のある状態から、流動化により高低差が均された平坦な表面へと変化するとともに、ソルダーペースト4中の半田粒子4 a は低粘度となったペースト中を沈降し、電極2の上面や電極2間の隙間に凝集する。

【0019】そしてある時間が経過すると、ソルダーペ ースト4中の半田粒子4aの大半が凝集した状態とな り、この状態で加熱されることにより半田粒子4 a は溶 融する。溶融した半田粒子4aのうち、電極2の表面の 近傍のものが電極2に溶着するとともに、相接する半田 粒子4aは相互に吸い寄せられる。このとき、電極2間 の隙間部分に十分な量の半田粒子4 a が凝集している場 合には、相隣した電極2相互を溶融半田が連結して半田 ブリッジを形成する。

【0020】このように、半田ブリッジ形成の条件とし 10 の形成方法の工程説明図 ては、電極2間での半田粒子4 a の凝集が必要であると とから、半田ブリッジを防止するためには、半田粒子4 aがこの部分に凝集しない間に半田を溶融温度以上に加 熱して、電極2の近傍の半田粒子4aを速かに電極2に 溶着させればよい。すなわち加熱温度が、ソルダーペー スト4の粘度低下が顕著となる温度(80℃)を越えて 半田の溶融温度に到達するまでの昇温時間を適切に設定 することにより、半田粒子4aの凝集を抑制して半田ブ リッジの形成の確率を低下させ、したがって電極2間の 短絡による不具合を減少させることができる。

【0021】上記の適切な昇温時間の目安としては、試 行結果から得られた適正昇温時間値である60秒を採用 する。この昇温時間は、従来のブリコート半田形成方法 の昇温時間の略半分以下であり、上述の半田ブリッジに よる不具合減少の効果とともに、タクトタイム短縮の効 果を得ることができる。なお、本実施の形態では、基板 の電極にプリコート半田を形成する例を説明している が、電子部品の電極上にブリコート半田を形成する場合 にも本発明を適用することができる。

# [0022]

【発明の効果】本発明によれば、ソルダーペースト塗布 後の加熱工程において、加熱温度が80℃を越えて半田\* \*の溶融温度に到達するまでの昇温時間を60秒以内とす ることにより、ソルダーペーストの流動時間を短くして 加熱により軟化したソルダーペースト中での半田粒子の 凝集を抑制して、半田ブリッジの形成を防止することが できる。また、昇温時間を従来方法と比較して大幅に短 縮することとなり、タクトタイムを短縮して生産性を向 上させることができる。

# 【図面の簡単な説明】

【図1】(a)本発明の一実施の形態のブリコート半田

- (b) 本発明の一実施の形態のブリコート半田の形成方 法の工程説明図
- (c) 本発明の一実施の形態のブリコート半田の形成方 法の工程説明図
- (d) 本発明の一実施の形態のブリコート半田の形成方 法の工程説明図

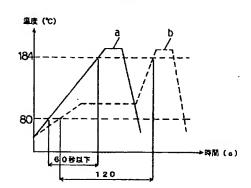
【図2】(a)本発明の一実施の形態の基板の斜視図

- (b) 本発明の一実施の形態のメッシュマスクの斜視図
- (c)本発明の一実施の形態のメッシュマスクの断面図 【図3】本発明の一実施の形態のブリコート半田の形成
- 方法における加熱プロファイルのグラフ

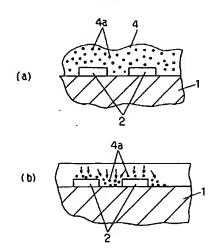
【図4】(a) 本発明の一実施の形態の基板の部分断面

- (b) 本発明の一実施の形態の基板の部分断面図 【符号の説明】
- 1 基板
- 2 電極
- メッシュマスク
- 3a メッシュプレート
- 30 3 b、3 c マスクプレート
  - 4 ソルダーペースト
  - 4 a 半田粒子

【図3】

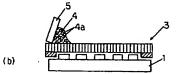


【図4】

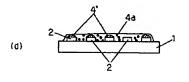


【図1】





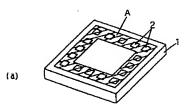


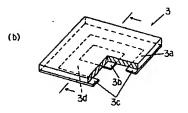


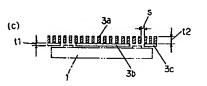
1 基板 2 電極 3 メッシュマスク

4 ソルダーペースト 4 m 半田粒子

【図2】







3。 メッシュプレート 3b. 3c マスクプレート